別紙６－５・別紙６－６　（略）
別紙７～別紙８　（略）
Ⅱ　ＷＨＤＣモード法
1.～8.　（略）
9.　測定機器の仕様と検定
9.1.～9.3.　（略）
9.4.　ＰＭの測定及びサンプリングシステム
9.4.1.～9.4.3.　（略）
9.4.4.　ＰＭ捕集フィルタ
　希釈された排気は、試験シーケンス中、9.4.4.1.から9.4.4.3.までの要件に適合するフィルタによってサンプルを採取する。
9.4.4.1.　フィルタの仕様
　全てのフィルタタイプは、0.3μmのＤＯＰ（ジオクチルフタレート）の収集効率が少なくとも99％であること。フィルタの材料は以下のいずれかとする。
(a)　フルオロカーボン（ＰＴＦＥ）コーティングを施したガラス繊維
(b)　フルオロカーボン（ＰＴＦＥ）膜
　また、フィルタとフィルタホルダーのシールのために、フィルタ材料の外周に不活性ポリマーリングを接着することができる。不活性ポリマーリングはポリメチルペンテン（ＰＭＰ）、ＰＴＦＥまたは試験機関との事前の合意があれば同等の不活性材料を使用してもよい。
9.4.4.2.・9.4.4.3.　（略）
9.4.5.・9.4.6.　（略）
9.5.　（略）
10.　粒子数測定試験手順
10.1.・10.2.　（略）
10.3.　粒子数サンプル流量の補正―分流希釈システム
10.3.1.　（略）
10.3.2.　サンプリングの比例制御において使用した分流希釈システムへの瞬時排出ガス流量（q_{mp}）は、以下の(a)又は(b)の方法により補正すること。
(a)　抽出された粒子数サンプル流を廃棄する場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き換えるものとする。
$$q_{mp}=q_{mdew}-q_{mdw}+q_{ex} \quad (93)$$
　q_{mp}　：分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量［kg／ｓ］
　q_{mdew}：希釈排出ガス質量流量［kg／ｓ］
　q_{mdw}　：希釈空気質量流量［kg／ｓ］
　q_{ex}　：粒子数サンプル質量流量［kg／ｓ］
　分流システムコントローラに送るq_{ex}信号は、常にq_{mdew}の0.1％以内の精度とし、かつ、少なくとも１Hzの周波数で送ること。この場合において、信号は５Hz以上のサンプルの１秒平均値を１Hzで送るものでよい。

別紙６－５・別紙６－６　（略）
別紙７～別紙８　（略）
Ⅱ　ＷＨＤＣモード法
1.～8.　（略）
9.　測定機器の仕様と検定
9.1.～9.3.　（略）
9.4.　ＰＭの測定及びサンプリングシステム
9.4.1.～9.4.3.　（略）
9.4.4.　ＰＭ捕集フィルタ
　希釈された排気は、試験シーケンス中、9.4.4.1.から9.4.4.3.までの要件に適合するフィルタによってサンプルを採取する。
9.4.4.1.　フィルタの仕様
　全てのフィルタタイプは、0.3μmのＤＯＰ（ジオクチルフタレート）の収集効率が少なくとも99％であること。フィルタの材料は以下のいずれかとする。
(a)　フルオロカーボン（ＰＴＦＥ）コーティングを施したガラス繊維
(b)　フルオロカーボン（ＰＴＦＥ）膜
9.4.4.2.・9.4.4.3.　（略）
9.4.5.・9.4.6.　（略）
9.5.　（略）
10.　粒子数測定試験手順
10.1.・10.2.　（略）
10.3.　粒子数サンプル流量の補正―分流希釈システム
10.3.1.　（略）
10.3.2.　サンプリングの比例制御において使用した分流希釈システムへの瞬時排出ガス流量（q_{mp}）は、以下の(a)又は(b)の方法により補正すること。
(a)　抽出された粒子数サンプル流を廃棄する場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き換えるものとする。
$$q_{mp}=q_{mdew}-q_{mdw}+q_{ex} \quad (93)$$
　q_{mp}　：分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量［kg／ｓ］
　q_{mdew}：希釈排出ガス質量流量［kg／ｓ］
　q_{mdw}　：希釈空気質量流量［kg／ｓ］
　q_{ex}　：粒子数サンプル質量流量［kg／ｓ］
　分流システムコントローラに送るq_{ex}信号は、常にq_{mdew}の0.1％以内の精度とし、かつ、少なくとも１Hzの周波数で送ること。